

ロボット関連技術PRカード

1. 企業概要

会 社 名	株式会社ラポールシステム			代表者名	大谷 治美		
				窓口担当	佐々木 資夫		
事業内容	各種検査装置、SECSソフト他製造・販売			U R L	http://www.lapole.co.jp/		
主要製品	MEMSセンサ検査装置、外観検査他各種検査試験装置、半導体製造装置用通信ソフト他						
所在地	〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-16-2 千代田中央ビル						
電話／FAX 番号	03-3253-6000／03-3253-5444			E-mail	sasaki@lapole.co.jp		
資本金(百万円)	80	設立年月	1979 年4月	売上(百万円)	450	従業員数	17

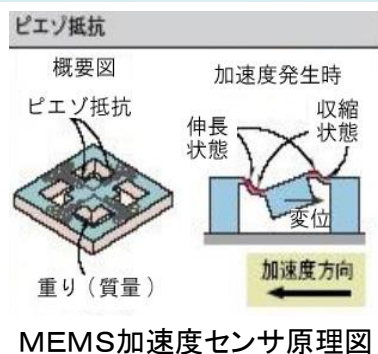
2. PR事項

『MEMSセンサの評価試験は弊社にお任せください!』

弊社は昭和55年、世界初のマイコン搭載型硬度計を開発して以来、一貫して『計測』『制御』『通信』を技術開発の3本柱と位置付け、常に先端技術に拘った装置開発を続けて参りました。

急速に進展する技術革新と大手企業各社のご要求にお応えする中で蓄積した技術は多岐に亘ります。これらを広く多製品に活用することが次代への貢献であり私共の願いでもあります。

MEMSセンサ検査装置



加速度/角速度センサ検査装置 1G 量産型セルシステム



出力測定・補正・合否判定
温度範囲: -40~+125℃
スループット: 約10万個/月

加速度センサ 高G印加検査用



出力測定
1~2,000G
試験温度: 室温

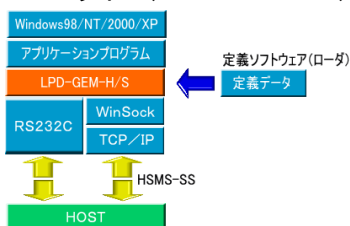
圧力センサ 検査装置



出力測定
圧力: 13~120 KPa
温度: -40~+250℃

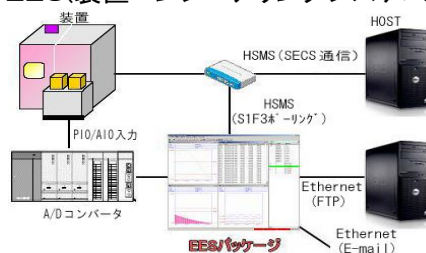
半導体製造装置通信システム

GEMドライバ(LPD-GEM-H/S)



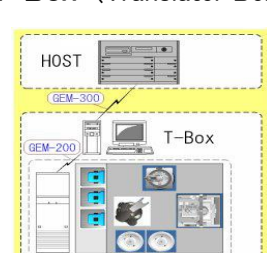
半導体製造装置向け SECS・GEM・HSMS 通信を実現します。

EES(装置エンジニアリングシステム)



装置の生産性向上用パッケージ。装置の詳細データ収集・保存・解析用プラットフォームを提供しEES機能を実現します。

T-Box”(Translator Box)



工場ホストと装置間の通信を翻訳し工場特有の要求を実現する外付けPCシステムです。

是非一度ご相談ください!

- MEMSセンサ受託検査業務
- ガラス外観欠陥検査装置
- SEMI通信パッケージ
- 膜厚測定装置
- ウエハカセット移載ロボットシステム
- レーザダイオードエーjing装置
- 製紙工場用紙面検査・高速処理ボード
- フィルム・シート欠陥検査装置
- 高速3D外観検査装置
- X線異物検出画像処理装置
- キャップ・ラベル検査装置
- 納豆検査装置
- 地すべり監視・警報システム
- FA用各種装置コントローラ.etc.

3. 特記事項(得意技術以外にPRしたい事項 例:特許情報、応用分野、表彰・認定)

- 平成18年度「MEMS加速度センサ検査装置」は経産省中小企業・ベンチャー挑戦支援事業・実用化研究開発事業補助金に採択、同東京都中小企業振興公社・可能性評価制度推奨事業に選定
- 平成20年度「MEMS圧力センサ検査装置」は東京都中小企業振興公社「新製品・新技術助成事業」に選定
- 独自の計測・制御・通信技術を活かしロボット検査システム等の開発に貢献します。